



关于“碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法”等 2 项团体标准委员会草案投票的通知

各有关单位：

团体标准 T/CASA013—2021《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法》、T/CASA 014—2021《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》已完成委员会草案的编制，根据标委会管理及标准制修订细则相关规定，现面向联盟标委会发起委员会草案投票，诚邀您对该项标准投票或提出宝贵意见、建议，并于 2021 年 10 月 29 日之前将《投票单》回复 casas@casa-china.cn，亦可扫描二维码进行投票。逾期未复函的按无异议处理。相关资料请见附件！

顺祝您工作顺利！

感谢您的支持！

附件 1：T/CASA013—2021《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法》（委员会草案）

附件 2：T/CASA014—2021《化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》（委员会草案）

附件 3：投票单

二维码投票单及投票链接



<http://casa-china.mikecrm.com/JhioFr5>

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2021 年 9 月 28 日

